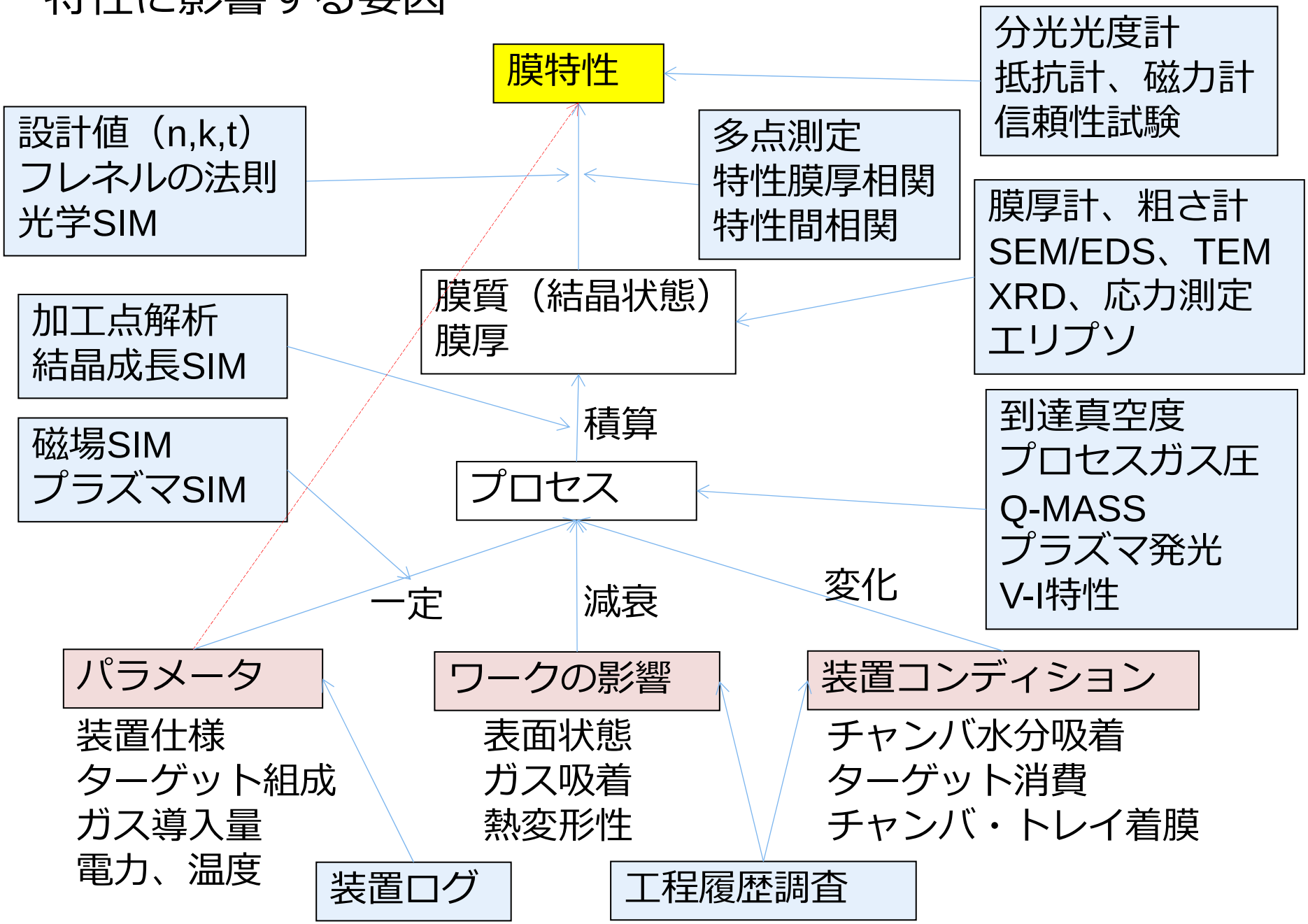
特性に影響する要因


膜特性
分光光度計
抵抗計、磁力計
信頼性試験
設計値（n,k,t）
フレネルの法則
光学SIM
多点測定
特性膜厚相関
特性間相関
膜厚計、粗さ計
SEM/EDS、TEM
XRD、応力測定
エリプソ
膜質（結晶状態）
膜厚
加工点解析
結晶成長SIM
積算
磁場SIM
プラズマSIM
プロセス
到達真空度
プロセスガス圧
Q-MASS
プラズマ発光
V-I特性
一定
減衰
変化
パラメータ
ワークの影響
装置コンディション
装置仕様
ターゲット組成
ガス導入量
電力、温度
表面状態
ガス吸着
熱変形性
チャンバ水分吸着
ターゲット消費
チャンバ・トレイ着膜
装置ログ
工程履歴調査